

真空技術でつくる未来

VACUUM 2012-真空展

2012年

10月17日[水] - 10月19日[金]

10:00~17:00 (最終日は10:00~16:30まで)

東京ビッグサイト 東ホール

主催：日本真空工業会 / 一般社団法人日本真空協会

共催：日刊工業新聞社

出展募集中



「3展同時開催」の相乗効果を活かし、より一層の集客を目指します。

展開イメージ

2012 土壌・地下水 環境展

展示内容 各種浄化・処理技術等

PAN-EXHIBITION FOR WASH AND CLEAN 2012 2012洗浄総合展

展示内容 各種洗浄装置・周辺機器

真空展

出展対象

- 真空ポンプ

低真空～中真空ポンプ (油回転ポンプ、ドライポンプ他)、高真空ポンプ (ターボ分子ポンプ、クライオポンプ他)、超高真空ポンプ、真空排気装置
- 真空計測器

ピラニ真空計、電離真空計、極高真空計、薄膜計測、制御機器
- 真空部品・材料

真空バルブ、真空スイッチ、各種導入端子、真空ポンプ油、成膜材料
- 真空冶金装置

真空溶解関連、真空熱処理関連、真空接合、真空改質関連
- 真空化学装置

真空乾燥、凍結乾燥、蒸留、濃縮、脱泡、脱臭、真空冷却、真空重合関連
- 真空薄膜形成加工装置

蒸着、スパッタリング、ドライエッチング、アッシング、イオン注入、CVD、エピタキシャル成長
- ガス分析装置

磁場型質量分析計、マスフィルタ型質量分析計、微量ガス分析装置、電子衝撃発光分光装置
- 表面分析装置

電子検出型、光電子分光分析装置、オージェ電子分光装置、電子回析装置、その他の表面分析装置、イオン検出型質量分析装置、二次イオン質量分析装置、イオン散乱分析装置、その他のイオン検出型表面分析装置、X線検出型、X線回析装置、電子線マイクロアナライザ、その他のX線検出型表面分析装置
- 試験装置

自動濡れ探し機、スペースチャンバー、真空引張・圧縮試験機、その他試験機
- 表面観察装置

走査型トンネル顕微鏡、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡
- その他の真空利用装置

液晶注入、真空包装、真空充填、真空吸着、エポキシ注型、真空含浸、真空リフター、真空プレス、真空ピンセット、プラズマクリーニング
- サービス業務

保守業務、修理・改造、指導・ソフトウェア、中古リサイクル販売、委託加工
- 要素機器

各種電源、空圧機器 (アクチュエーター)、シーケンス制御機器、機構部品、流体制御機器

出展料金 (消費税込)

- 《日本真空工業会会員企業》
 - ◆ 1～4小間で出展の場合・1小間当り 315,000円
 - 5～7小間で出展の場合・1小間当り 273,000円
 - 8～小間で出展の場合・1小間当り 241,500円
- 《一般企業》
 - ◆ 1小間当り 336,000円

申込締切

2012年6月29日(金)
※募集定数に達し次第締め切り

詳しい内容は
公式HPから

<http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum>

真空展 検索